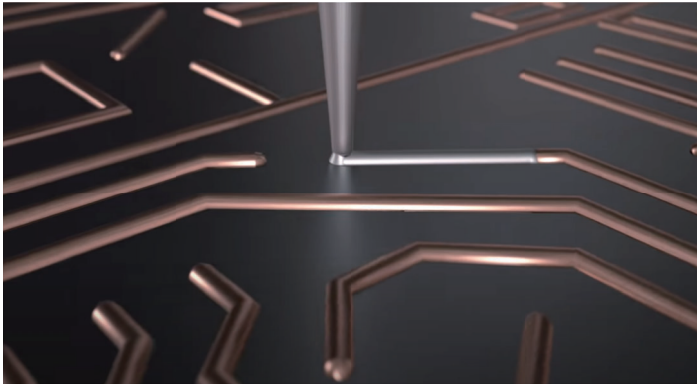


ナノ・マイクロプリンティング装置

HUMMINK 社(フランス)は、世界最細線直描装置を開発しました。

- 600nm-50 μ mのパターニング
- 最高 10 mm /sec の描画速度
- 多様な材料 (高粘度) にも適応可能
(Au, Ag, Cu, Graphen, polymer, etc.)
- 多様な基板に対応可能
(Si, SiO₂, Si₃N₄, Glass, Flexible, etc.)
- 多様なパターンの描画に対応可能
(Line, Circle, Grating, Dots, 3D pillar, etc.)



卓上型 R&D 装置 NAZCA

ナノインプリント関連装置

Obducat Technologies 社(スウェーデン)は、マイクロ・ナノリソグラフィソリューションの革新的な開発者として、世界をリードするサプライヤーです。ナノインプリントリソグラフィ、レジストおよびウェット処理、ファウンドリーサービスに注力、優れた COO(コスト・オブ・オーナーシップ)で高く評価されております。



微細加工表面パーティクル検査装置

Fastmicro 社(オランダ)は、清浄度を管理するシステムとして、イノベティブな表面付着パーティクルの検査ソリューション機器を販売するサプライヤーです。非平滑表面の付着物や、真空装置内のモニター等、これまで測定困難だった環境での検査も可能にしております。



マニュアル型検査装置 Sample Scanner

